

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ПЛАТО КВАНТОВАННОГО ХОЛЛОВСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В ДВУМЕРНОМ СЛОЕ НОСИТЕЛЕЙ В КРЕМНИИ

В.М.Пудалов, С.Г.Семенчинский

Для двумерных слоев носителей в Si-структурах металл – диэлектрик – полупроводник изучена форма плато холловского сопротивления в диапазоне относительных отклонений $\delta = 10^{-6} \div 10^{-2}$. Выявлена логарифмическая зависимость ширины плато от отклонения δ и линейная – от температуры.

До настоящего времени отсутствовали экспериментальные сведения о зависимости формы плато холловского сопротивления ¹ от тока и температуры, необходимые для апробации различных теоретических моделей ² квантового эффекта Холла (КЭХ) ¹. В данной работе исследовалась форма плато холловской компоненты тензора сопротивления ρ_{xy} двумерного слоя носителей при изменении напряжения на затворе V_3 кремниевой МДП-структуре. Измерения ρ_{xy} проводились в диапазоне относительных отклонений $\Delta\rho_{xy}/\rho_{xy} = 10^{-6} \div 10^{-2}$ вблизи значения ¹ $\rho_{xy} = h/e^2 = 6453,20$ Ом, соответствующего полному заполнению носителями одного четырехкратно ($i = 4$) расщепленного уровня Ландау.

Образцы представляли собой структуры металл – диэлектрик – полупроводник с инверсионным каналом n -типа, изготовленные на поверхности (100) Si p -типа. По обе стороны прямоугольного канала имелись две пары потенциальных электродов. Исследовались образцы двух типов: с малой площадью канала ($500 \times 50 \text{ мкм}^2$), толщиной диэлектрика 2000 \AA и подвижностью в максимуме $\mu^{max} \approx 1 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}^3$; с большой площадью канала ($1200 \times 400 \text{ мкм}^2$), толщиной диэлектрика 1300 \AA и подвижностью $\mu^{max} \approx 1,5 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$. Все измерения проводились в магнитном поле 80 кЭ . При значениях V_3 , соответствующих плато ρ_{xy} , компонента ρ_{xx} уменьшалась в $\sim 10^5$ раз (при $T = 0,4 \text{ K}$) по сравнению со значением в отсутствие магнитного поля.

Воспроизведимость формы плато. Известно, что форма плато ρ_{xy} на уровне $\Delta\rho_{xy}/\rho_{xy} \lesssim 10^{-5}$, вообще говоря, может не повторяться от опыта к опыту и зависеть от предыстории образца ⁴, оставаясь, однако, постоянной в течение одного низкотемпературного эксперимента. Тем не менее, авторам удавалось многократно получать состояние образцов, называемое далее "равновесным", которое характеризуется следующими признаками: а) симметричным распределением потенциалов на контактах образца относительно его середины; б) максимальным значением подвижности μ и минимальным пороговым напряжением $|V_{\text{пор}}|$, а также их одинаковостью для различных участков образца; в) совпадением положения по V_3 плато ρ_{xy} и минимумов ρ_{xx}^{min} , измеряемых на разных участках образца. В "равновесном" состоянии ρ_{xy} в средней части плато постоянно с точностью до $\Delta\rho_{xy}/\rho_{xy} \ll 10^{-5}$ (рис.1), зависимости формы плато от различных параметров качественно повторяются от опыта к опыту и для разных образцов, а вариации $|V_{\text{пор}}|$ от опыта к опыту $\lesssim 0,2 \text{ В}$.

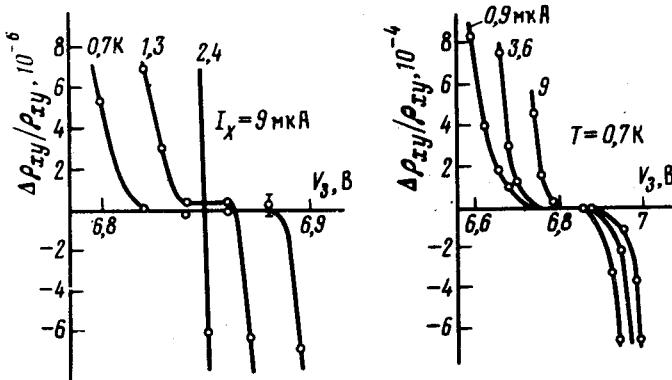


Рис. 1. Типичная форма плато ρ_{xy} ($i = 4$) для образца с каналом $1200 \times 400 \text{ мкм}^2$: *a* – при различных температурах T ; *b* – при различных токах I_x

Невоспроизводимость формы плато ρ_{xy} (V_3) может быть связана с вариациями распределения и амплитуды флуктуаций потенциала в двумерном слое носителей. "Равновесное" состояние соответствует минимальной амплитуде и однородному распределению флуктуаций потенциала, что достигается, возможно, при заполнении носителями всех ловушек на границе Si / SiO_2 . В неравновесном состоянии отсутствуют признаки *a* – *b*; одновременно резко увеличивается значение ρ_{xx}^{\min} (например от $8 \cdot 10^{-3}$ Ом до ~ 1 Ом при $T = 0,4$ К) и появляется, как правило, немонотонная зависимость ρ_{xy} (V_3) в районе плато.

Форма плато. Количественной характеристикой формы плато принята ширина Δ , измеренная на уровне заданного относительного отклонения δ холловского сопротивления ρ_{xy} от опорного значения, в качестве которого было выбрано значение ρ_{xy} в середине плато при $T = 0,7$ К, $I_x = 9$ мА. На рис. 2 изображена зависимость ширины плато от различных токах I_x и температурах T . Семейство кривых на рисунке построено для образца с большой площадью канала; данные на врезке – для образцов с малой площадью канала.

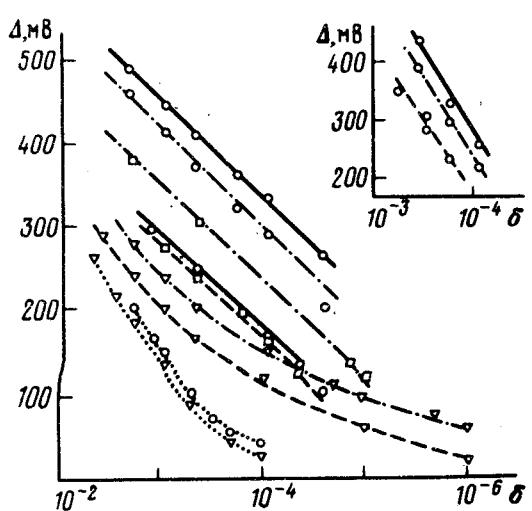


Рис. 2

Рис. 2. Зависимость ширины плато Δ от модуля заданного отклонения δ : $\circ - I_x = 0,9 \text{ мКА}$, $\square - 3,6 \text{ мКА}$, $\nabla - 9 \text{ мКА}$; сплошные линии – $T = 0,4$ К, штрих-пунктир – 0,68 К, пунктир – 1,3 К, точки – 2,36 К

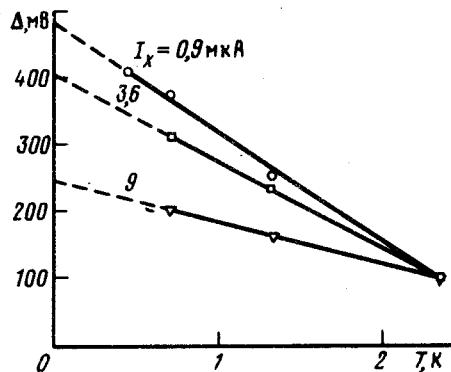


Рис. 3. Зависимость ширины плато Δ (для отклонения $\delta = 5 \cdot 10^{-4}$) от температуры для образца с большим каналом

В довольно широком диапазоне отклонений δ , токов и температур эта зависимость имеет логарифмический характер, причем, как это видно из рис. 2, наклон соответствующих прямых не зависит ни от температуры, ни от тока. Исключение составляет область больших температур $T = 2,4$ К и больших токов $I_x \geq 9$ мА, где логарифмическая зависимость, если

и существует, то в значительно меньшем диапазоне δ . В этих же условиях температурная зависимость ширины плато близка к линейной (рис. 3), а $\Delta\rho_{xy} \propto \rho_{xx}$.

Из рис. 2 и рис. 3 следует, что связь между шириной плато, температурой и относительным отклонением сопротивления имеет вид

$$\Delta = f(T) + B \ln \delta . \quad (1)$$

Такой вид зависимости не удается объяснить с помощью модели со связанными одиночными состояниями носителей на короткодействующих флуктуациях потенциала^{2,5} и активацационным механизмом проводимости^{6,7}. Из этой модели, часто привлекаемой для качественного объяснения КЭХ⁵⁻⁷, следует, что зависимость ширины плато должна иметь иной вид:

$$\Delta = A + T^\alpha \ln \delta ,$$

где A – константа; $\alpha = 1$ или $1/3$ в зависимости от механизма проводимости².

Для количественного уточнения зависимости (1) и выбора иной модели необходимо проведение измерений в области больших токов, при лучшем разрешении по напряжению ($\lesssim 10$ нВ), а также установление зависимости от магнитного поля.

Авторы благодарны З.Д.Квону – за обсуждение результатов и предоставление образцов, И.Я.Краснополину и В.С.Эдельману – за ценные советы, М.С.Хайкину – за внимание к работе.

Литература

1. Von Klitzing K.V., Dorda G., Pepper M. Phys. Rev. Lett., 1980, 45, 494.
2. Thouless D.J. J. Phys. C., 1981, 14, 3475.
3. Верников М.А., Пазинич Л.М., Пудалов В.М., Семенчинский С.Г. Письма в ЖТФ, 1982, 8, 820.
4. Wagner R.J., Lavine C.F., Cage M.E., Dziuba R.F., Field B.F. Surface Sci., 1982, 113, 10.
5. Prange R.E. Phys. Rev. B, 1981, 23, 4802.
6. Jordansky S.V. Solid State Comm., 1982, 43, 1.
7. Laughlin R.B. Phys. Rev. B, 1981, 23, 5632.